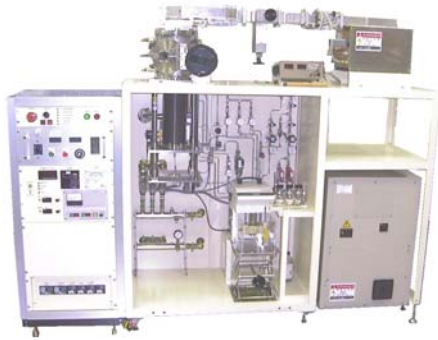


SDM-2



・特徴

マイクロ波CVDによるダイヤモンド薄膜の試験製造装置。シリコンウエハ上に直径10mm程度、厚み10 μ 以上のダイヤモンド膜を成膜できます。

・仕様

チャンバー排気系：

チャンバー・ロータリーポンプ・排気コントロールシステム・排気バルブ・リークバルブ・配管

ガス導入系：

マスフロー・フローメーター・ストップバルブ・フィルター・チェックバルブ・コントロールバルブ
継手・配管・プレッシャースイッチ

エア導入系：

ソレノイドバルブ・レギュレーター・圧力スイッチ・継手・配管

水挿入系：

マニホールド・フローチェッカー・バルブ・継手・チューブ

電源系：

マイクロ波電源 2.45GHz/3kW

計測系：

ピラニ真空計

基板系：

ヒーター基板（空冷/水冷付）・ヒーターコントローラー・上下機構・測長